# **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

02065150

**PUBLICATION DATE** 

05-03-90

APPLICATION DATE

30-08-88

APPLICATION NUMBER

63213646

APPLICANT: FUJITSU LTD;

INVENTOR: TOGASHI KENJI;

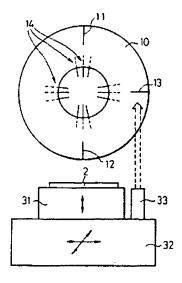
INT.CL.

H01L 21/66 G01R 31/00 G01R 31/28~

TITLE

: AUTOMATIC ALIGNMENT METHOD

FOR PROBE CARD



PURPOSE: To enable parallel alignment of a probe card to a chip to be measured in a short time and highly accurately by detecting marks provided on the probe card side one after another by a detection means provided on the stage side.

CONSTITUTION: A stage is shifted so as to search for the mark 11 of a probe card by a CCD camera. Next, the stage is shifted in the Y or X direction so as to search for the mark 12 of the probe card. At the position that the mark 12 is detected the angle deviation is calculated from the shifting amounts in the Y or X direction, and the parallel alignment of the probe card is done. Hereafter, a mark 13 is searched, and the stage is returned to the center position of the probe card and alignment is finished. Hereby, the parallel alignment of the probe card to the chip to be measured can be done in a short time highly accurately.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

#### ⑫公開特許公報(A) 平2-65150

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)3月5日

H 01 L G 01 R 21/66 31/00 31/28

7376-5F 7905-2G В

> G 01 R 31/28 6912-2G

K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

プローブカードの自動位置合せ方法 ❷発明の名称

> @特 頭 昭63-213646

昭63(1988)8月30日 頭 29出

明者 ⑫発

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 志

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 勿出 願 人

外4名 弁理士 青木 00代 理 人

# l. 発明の名称

---プローブカードの自動位置合せ方法

### 2. 特許請求の範囲

1. 半導体ウェーハのチップ上の各パッドに対 応するプローブ針を有するプローブカード上にお ける中心を通る1つの延長線に沿って、該プロー ブカードの中心から等距離の各点にそれぞれ第1 および第2の目印を設け、該第1および第2の目 印を順次、抜ウェーハを載置したステージ側に設 けられた探知手段によりサーチして該チップと該 プローブカードとの位置合せを自動的に行うよう にしたことを特徴とするプローブカードの自動位 置合せ方法。

2. 核プローブカード上における中心を通りか つ譲1つの延長線と直交する他の延長線上に第3 の目印を設け、該第1および第2の目印をサーチ した後、更に該第3の目印をサーチするようにし た、請求項1記載の自動位置合せ方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (機要)

ウェーハ状態でのチップと孩チップの測定に用 いるプローブカードとの自動位置合せの方法に関

該プローブカードの位置合せを高精度かつ高速 にかつ自動的に進成することを目的とし、

半導体ウェーハのチップ上の各パッドに対応す るプローブ針を有するプローブカード上における 中心を通る1つの延長線に沿って、該プローブカ - ドの中心から等距離の各点にそれぞれ第1およ び第2の目印を設け、該第1および第2の目印を 脳次、該ウェーハを載置したステージ側に設けら れた採知手段によりサーチして餃チップと筷プロ ープカードとの位置合せを自動的に行うように構 成される。

#### (産業上の利用分野)

本発明はウェーハ状態での半導体デバイス(す なわちウェーハ状態でのチップ)と、該チップの タにもとづいて該プローブカードの高精度な位置 合せ(平行合せ)を短時間で自動的に達成するこ とができる。

#### (実施例)

第1図は、本発明に用いられるプローブカードの構成と該プローブカードの位置合せの原理を説明する図であって、該プローブカード10には被測定チップの各ポンディングパッドに接触する多数のプローブ針14が配置されている。

ープカードのX軸上の一方の周辺部)に、上記と同様の反射能を有する第3の目印13が設けられる。

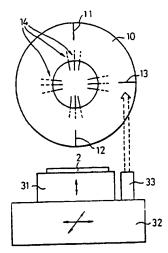
第2図は、第1図に示されるプローブカードの 位置合せを行う装置の全体構成を例示する図であって、第1図に示される部分と同等の部分には共

通の符号が付されている。該第2回中、15は該アローブカード10を固定したアローブリング15はであって、該アローブリング15はプローバ医アローバスを介して、なアリング18を介して水で、では、では、一下の一下ででは、19に対し、15をでは、15をでは、10に、15をでは、15

一方、上記ステージ下部32は X 軸レール34 および Y 軸レール35に沿って X 方向および Y 方向に駆動可能であり、ステージ32側に設けられたモータと CPU 4 との間で位置指令の授受が行われ、これにより 該ステージの駆動制御が行われる。また該ステージ上部31は Z 方向に移動可能であってこれによりプローブ針とをボンディングパッドとの後飛状態が制御されるとともに、その水平

面内での回転により終ウェーハの平行合せ(終ウェーハ上に設けられたスクライブラインと終ステージのX. Y移動方向との平行合せ)が行われる。

更に本発明では、該ステージ32をX . Y両方 向に所定の手順にしたがって順次移動させて接C CDカメラ33により上記プローブカード上の目 印11.12、および 1.3 を順次探知し、その際の該 ステージのX,Y両方向の移動量にもとづいて狭 ウェーハ上の被測定チップに対する線プロープカ ードの角度ずれを膝 CPU 4 において算出し、膝算 出データにもとづいてモータコントロールユニッ ト51を介して上記モータ52の回転角を制御し て上記カードθの調整を行う。すなわち従来、上 記カード8の調整(すなわちモータ52の回転) を作業者が目視によって行っていたのに対し、本 発明では上記CCDカメラによる抜各目印の採知 結果にもとづいて核 CPU 4 において算出される算 出データをもとにして、上記カード8の調整を高 精度でかつ自動的に制御するようにしたものであ ā.

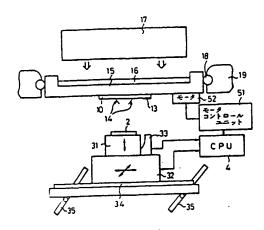


本発明に用いられるプロープカードの構成と該 プロープカードの位置合せの原理を説明する図

# 第1図

33・・・カメラ

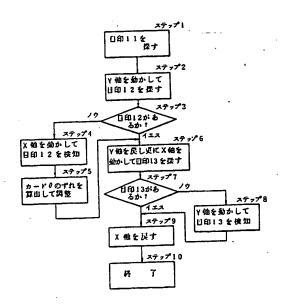
2 · · · ウェーハ 10 · · · プロープカード 11,12,13 · · · アルミニウムなどの目印 14 · · · プロープ針 31,32 · · · ステージ



第1図に示されるプローアカードの位置 合せを行う装置の全体構成を例示する図

## 第2团

4··· CPU 15··· プローアリング 17··· テスタヘッド 34··· X 軸レール 35··· Y 軸レール



第2個の模能を用いてプローブカードの位置 台社を実行する手腕をフローナポートで示す目

## 第3図